

モノトル・高流量ガス精製装置は、ゲッター式の精製装置で、出口不純物レベルは O<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>O、CO、CO<sub>2</sub>、N<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>、THC において 1ppb 以下になります。

この精製装置は、入口ガス不純物レベルが、ファイブナイン(純度 99.999%)以上の純度で定格流量範囲以内の運転の場合、1年以上ゲッター筒を交換する必要はありません。

装置内の出入口配管には、ステンレスダイヤフラムバルブ、0.003 μm のパーティクルフィルターが装備されています。

電気系統と配管とが分離されており、電気系統と配管系は別々のドアによりアクセスできます。排気筒とファンが配管側に含まれています。自動安全装置のバイパス弁は標準装備です。

「ライフ状態表示」のランプの点灯によりゲッターの寿命がなくなったことを知らせますので、ゲッター一筒を交換して下さい。

マイクロプロセッサの LC 表示で精製状態の確認ができます。制御出力により、警報を遠隔で表示できます。コントローラーに接続することで遠隔停止の操作も可能です。

### 用途

- ・MOCVD-Ⅲ-V プロセス
- ・光ファイバー製造用
- ・シリコン EPI
- ・クリスタル・プーリング
- ・インプラント
- ・PVD/CVD のプロセスガス用
- ・キャリアガス
- ・フォトリソグラフィ

\* その他の用途についてはお問い合わせ下さい

### 精製対象ガス

- ・水素

### 対象除去不純物

- ・O<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>O、CO、CO<sub>2</sub>、N<sub>2</sub>
- ・パーティクル



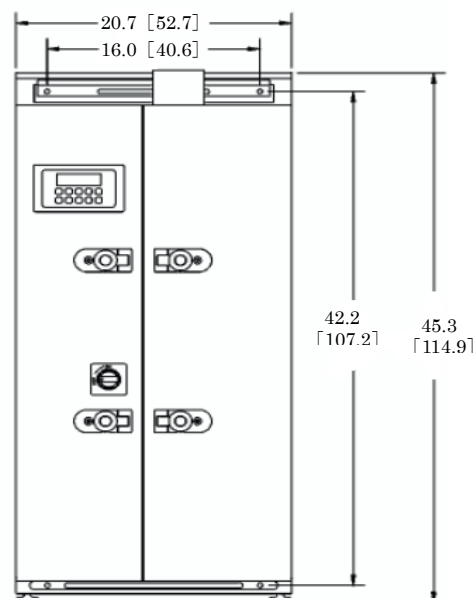
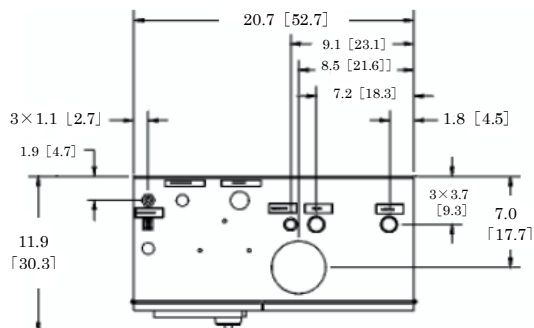
PS4-HIGHFLOW

### □ 寿命:

定格流量で標準的なファイブ・ナインのガスを基準として1年(具体的な寿命についてはお問い合わせください。)

### □ 最大定格流量: 150slpm

### □ 最大圧力: 0.97MPa



インチ  
[cm]

## 精製能力

不純物	出口純度
入口ガス純度: 5-9's(99.9995%)	
O <sub>2</sub>	<1 ppb
H <sub>2</sub> O	<1 ppb
CO	<1 ppb
CO <sub>2</sub>	<1 ppb
N <sub>2</sub>	<1 ppb

## 標準仕様

外形寸法(高さ×幅×奥行)	約 113×53×30cm
重さ	70kg 以下
入口接続	1/2 インチ VCR オス
出口接続	1/2 インチ VCR オス
ゲッター運転温度	300°C
パーティクルフィルター	0.003 μm オールメタルタイプ
計装エア入口 接続	3/8 インチ FNPT
圧力 リリーフ ベント接続	1/4 インチ VCR オス
装置周囲必要スペース	正面に 1m 以上のスペース
設備電力(208/240 VAC) 10A	2.4KW(平均電力 1.0W)
熱電対	Kタイプ、SUS シース、3 本、無接地
接ガス面仕上げ	平均 10 μm インチ、316L、12RA Max 電解研磨仕上げ

## オーダー情報

型式	ガスの種類	電源電圧
PS4-MT50-H-1	水素ガス	208VAC
オプション		
PS4-MT50-MODBUS	Modbus 顧客インターフェース接続	
PS4-MT50-NP	窒素パージ C1、Div. II env.	
PS4-MT50-H2SEN	水素センサー(with alarm)	
交換用ゲッター筒		
PF4-MT50-H	ハイフロー カラム	